

新日本製鐵(株)釜石製鐵所 製鋼線材技術室 ○木村勝一, 工藤絏一  
植崎啓邦

1. 緒 言

高炭素鋼ブルーム铸片の中心偏析低減には, 一般に低温铸造, 電磁搅拌等の等軸晶率増加対策がなされている。しかし, 中心偏析に及ぼす低温铸造, 電磁搅拌の影響を凝固組織から定量的に調査した例は少ない。そこで本報告では, 垂直型ブルーム連铸機 (248 × 384 mm 断面) における高炭素鋼 (0.82 %C) の中心偏析に及ぼす低温铸造, 铸型内電磁搅拌 (M-EMS) の影響を等軸晶形態の変化に着目して調査した。

2. 調査方法

表1に示す成分の高炭素鋼を铸造速度 0.5 ~ 0.6 m/min ΔT 8 ~ 27°C で铸造した。M-EMS は有り, なしの2水準とした。溶鋼温度の調整は, TD内冷材投入装置により実施した。中心偏析の評価は, CMA及び铸片のマクロエッチ (エッチプリント以下EP) から得られた偏析を画像解析装置で定量化した。等軸晶の形態も同時に測定した。

Table 1. Chemical composition

C	Si	Mn	P	S	casting speed	M-EMS
0.81	0.20	0.48	0.007	0.005	0.5 ~ 0.6	ON
0.83	0.23	0.53	0.015	0.010	m / min	OFF

3. 調査結果

1) M-EMSを適用していない ΔT 11°C と 20°C のCMAによる等軸晶形態を写真1に示す。

ΔT 11°C は微細な等軸 dendrait 状, ΔT 20°C は粗い分岐 dendrait 状になっていた。

2) M-EMSを適用した ΔT 16°C と 27°C の等軸晶形態を写真2に示す。ΔT 16°C はM-EMSを適用していない ΔT 11°C と同様な等軸 dendrait 状となっていた。ΔT 27°C は, M-EMSでも粗い分岐 dendrait が一部に見られた。

3) EPより得られた微細な等軸 dendrait 発生量と ΔT, M-EMSの関係を図1に示す。M-EMSを適用しない場合, 等軸 dendrait は ΔT 20°C 付近から発生し, ΔT の低下により増加する。M-EMS材は, ΔT 20°C 以上でも等軸 dendrait が発生し, ΔT 16°C 付近で M-EMSなし材と同じ発生量となる。

4) EPより得られた中心偏析量と ΔT, M-EMSの関係を図2に示す。ΔT の低下により中心偏析量は低下する。M-EMS材は, ΔT 18°C 付近から低位安定するが, M-EMSなし材は ΔT 13°C 付近からである。

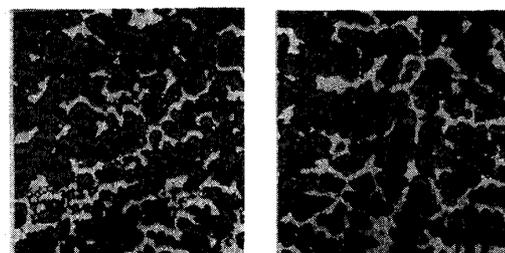


Photo. 1 Manganese distribution of equiaxed crystal of non M-EMS bloom (CMA)

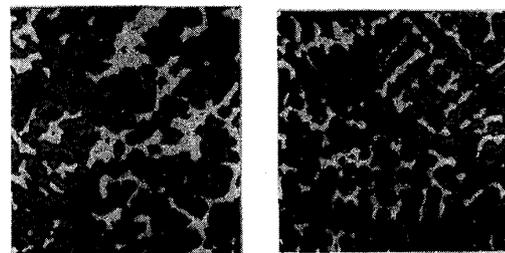


Photo. 2 Manganese distribution of equiaxed crystal of M-EMS bloom (CMA)

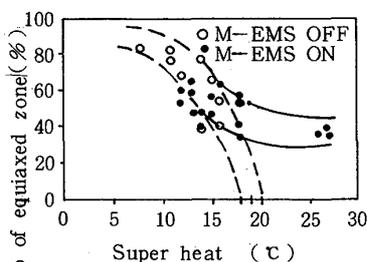


Fig.1 Effect of M-EMS on equiaxed crystal

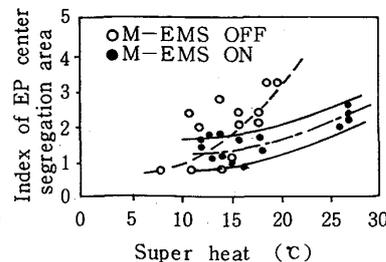


Fig.2 Effect of M-EMS on center segregation area

4. 結 言

中心偏析は, 微細な等軸 dendrait 発生量の増加によって低減する。M-EMS は, 低温铸造効果を促進し, 比較的高温でも微細な等軸 dendrait を多量に発生させる。